

AE传感器

校正服务

Fuji Ceramics 是日本国内唯一提供采用绝对灵敏度校正法（相互校正法、声压法）进行校正服务的企业。

声发射传感器的校正方法

声发射传感器的校准方法大致分为绝对灵敏度校正法和相对灵敏度校准法两类。由于相对灵敏校准法只能得到参考数据，故这里的概要说明作为正式方法的绝对灵敏度校准法。

绝对灵敏度校准方法	一次校准方法	CEN ISO/TR 13115:2011 相互校准法 (NDIS 2109)	日本非破坏检查协会准则 (NDIS) 将3个同种类的可逆变换元件安装于钢座上，由发送和接收都独立的3组构成的校准方法
		ISO12713 (ASTM E1106)	美国NIST开发的方法 在钢板上破坏玻璃毛细管，用标准检测器（静电电容型变位计）和AE传感器同时接收表面脉冲波形，用这些数据校准传感器特性。
	二次校准方法	CEN ISO/TR 13115:2011 声压法 (NDIS 2109)	通常的出厂检验方法 由相互校准出电压灵敏度的一个声发射传感器安装在钢板上用来发射脉冲信号，以便得出被检声发射传感器的接收灵敏度。

客户自行检验传感器的灵敏度

校准用的声发射传感器REF-VL或REF10M用作标准传感器，可简易地检验您手中的声发射传感器的灵敏度。

